УДК 537.523 (575.2) (04)

ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ ПЛАЗМЫ ЭЛЕКТРОДНОГО СВЧ-РАЗРЯДА

Ю.А. Лебедев – докт. физ.-мат. наук **А.В.** Татаринов – канд. физ.-мат. наук **И.Л.** Эпштейн – канд. физ.-мат. наук Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН

Modification of quasi-static model of microwave discharge quasi-neutral plasma is offered.

Введение. Электродный СВЧ-разряд является ярким примером самоорганизации плазмы, в результате этого у поверхности электрода, по которому подводится СВЧ энергия, в разрядной камере в молекулярных газах образуются шарообразные плазменные структуры [1].

Зондовое и оптическое исследование разряда при давлениях 0.5—15 Тор показало, что внешняя граница плазменного образования является резкой и на ней концентрация электронов уменьшается более чем на порядок величины [2, 3]. На основе анализа экспериментальных результатов был сделан вывод о том, что внешняя граница может объясняться присутствием пограничного электрического слоя с пространственным разделением заряда [2, 3].

В настоящей работе квазистатическая модель квазинейтральной плазмы [4] была модифицирована для исследования возможности возникновения областей разделения зарядов в пространстве между электродами.

Модель. Экспериментальная разрядная камера представляет собой закороченный отрезок коаксиальной линии с обрезанным центральным электродом. Разряд в такой системе в различных газах горит в виде шара, окружающего торец центрального электрода, и обладает некой симметрией, близкой к сферической (рис. 1а). Поэтому для описания разряда в качестве первого шага была разработана стационарная одномерная модель в камере со сферической симметрией (рис. 1б). Расчеты проводились для разряда в водороде, $T_g = 300~K$. Считалось, что амплитуда поля в плазме с диэлектрической проницаемостью ε определяется формулой [5]

$$E(r) = \overline{E}_{micr} / \varepsilon = E_0 \left(\frac{r_{el}}{r} \right)^2 \left\{ (1 - n)^2 + \frac{v_{en}^2}{\omega^2} \cdot n^2 \right\}^{-\frac{1}{2}}, \tag{1}$$

где $n=n_e/n_c$ — концентрация электронов, отнесенная к критическому значению $n_c=\left(v_{en}^2+\omega^2\right)m/4\pi~e^2$; $\omega=1.54\cdot10^{10}~c^{-l}$ — круговая частота СВЧ поля; $v_{en}=v_{en}(E)$ — частота столкновений электронов с молекулами; E_0 — амплитуда поля, установившегося на поверхности внутреннего электрода радиуса r_{el} .

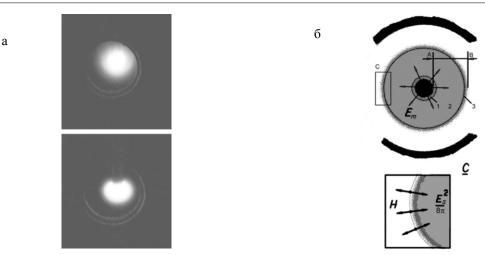


Рис. 1. Фотографии электродного СВЧ-разряда (a): вверху – водород, p = 4 Top; внизу – азот, p = 2 Top. Схема типичной плазменной структуры, используемой в расчетах со сферической симметрией (б). Центральный электрод и стенки камеры показаны черным цветом. Линии CBY поля E_m — стрелками. В плазме зоны 1 и 3 соответствуют приэлектродному и внешнему пограничным слоям, область 2 - квазинейтральная плазма. AB – путь интегрирования. Фрагмент плазмы C показан внизу с условием баланса напряжений на внешней границе.

Для описания плазмы используются уравнения баланса заряженных частиц, уравнение Пуассона и выражение для поглощенной в разряде мощности:

$$\frac{d(n_e D_e)}{dr} = -\Phi - \mu_e n_e E_s \,, \tag{2}$$

$$\frac{d(n_e D_e)}{dr} = -\Phi - \mu_e n_e E_s, \qquad (2)$$

$$\frac{d(n_p D_p)}{dr} = -\Phi + \mu_p n_p E_s, \qquad (3)$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (r^2 \Phi) = v_i n_e - \alpha_r n_e n_p. \tag{4}$$

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2E_s) = 4\pi e(n_p - n_e). \tag{5}$$

$$P = \int_{V} \sigma E_m^2 dV .$$
(6)

Коэффициенты в уравнениях являлись функциями локального значения СВЧ поля $E_m(r)$ и рассчитывались с помощью однородного уравнения Больцмана. В балансе заряженных частиц учитывались процессы объемной ионизации однократным электронным ударом и диссоциативной рекомбинации, а также диффузия и дрейф.

Идея, заложенная в процедуру расчетов, заключалась в следующем. Если начать интегрирование уравнений (1)–(5) с поверхности электрода в направлении внешней стенки разрядной камеры, то профили плотности плазмы всегда будут иметь следующую структуру: вблизи электрода возникает пограничный слой разделения заряда, затем протяженная область квазинейтральной плазмы и затем снова возникает тонкий слой разделения разряда. В последнем, вследствие разделения заряда, возникает электрическое напряжение, препятствующее диффузионному расширению плазмы.

Известно, что ширина пограничного слоя - порядка нескольких длин Дебая. Плазму в нем можно считать условно бесстолкновительной. Положение внешней границы разряда определяется условием [6, 7], при котором давление электростатического поля E_s в точности уравнивает давление, производимое разлетающимися заряженными частицами

$$\frac{E_s^2}{8\pi} \approx n_e \left\{ kT_e + m_e v_e^2 \right\} + n_p \left\{ kT_p + m_p v_p^2 \right\} = H(E_s) \quad (A),$$

где $\ \upsilon_{e}\,,\,\upsilon_{p}\,$ – направленные скорости электронов и ионов у поверхности раздела.

Расчет начинался с поверхности электрода S, на которой в силу идеальной каталитичности и отсутствия эмиссии заряженных частиц $n_e(S) = n_p(S) = 0$. Потоки ионов и электронов на стенке равны. Известно, что поток электронов из плазмы на стенку равен тепловому. Такое же условие справедливо и для внешней границы плазмы S^* : $\Phi(S^*) = 1/2n_e \ \upsilon_{T_e}$ (B), где $\ \upsilon_{T_e}$ — тепловая скорость электронов. Значение амбиполярного поля на электроде подбиралось в зависимости от задаваемого потока и СВЧ поля. При других значениях амбиполярного поля, отличающегося от подобранного, решение не существовало.

Интегрирование системы (1)-(6) проводилось методом перескока от поверхности центрального электрода до такого значения радиуса, при котором будут одновременно выполняться условия (А) и (B).

Результаты. При заданном значении напряженности СВЧ поля на электроде существует решение, в нем на некотором расстоянии от поверхности центрального электрода образуется пограничный слой. Его положение не зависит от положения внешней стенки камеры.

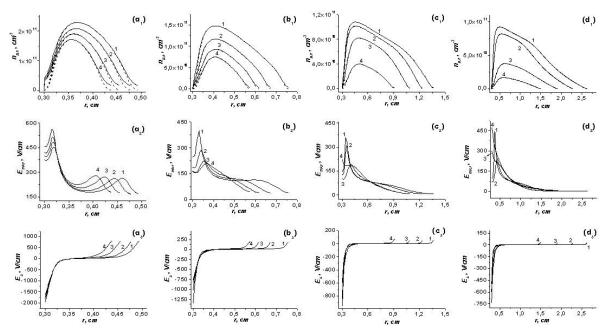


Рис. 2. (a_1) , (b_1) , (c_1) , (d_1) – радиальные профили ионной и электронной плотностей, (a_2) , (b_2) , (c_2) , (d₂) – профили СВЧ поля и (a₃), (b₃), (c₃), (d₃) профили электростатического поля при различных давлениях и поглощенной мощности (расчет при $T_g = 300 \ K$):

- (a_1) , (a_2) , $(a_3) p = 4$ *Top*, числа 1, 2, 3, 4 соответствуют $P_{abs} = 26$, 22, 18, 15 *Bm*;
- (d_1) , (d_2) , (d_3) p q Top, числа 1, 2, 3, 4 соответствуют $P_{abs} = 18$, 11, 7, 5 Bm; (c_1) , (c_2) , (c_2) -p = 1 Top, числа 1, 2, 3, 4 соответствуют $P_{abs} = 18$, 11, 7, 5 Bm; (d_1) , (d_2) , (d_3) -p = 0.5 Top, числа 1, 2, 3, 4 соответствуют $P_{abs} = 14$, 11, 7, 3 Bm; (d_1) , (d_2) , (d_3) -p = 0.5 Top, числа 1, 2, 3, 4 соответствуют $P_{abs} = 12$, 7, 5, 2 Bm.

На рис. 2 показаны рассчитанные пространственные распределения концентраций заряженных частиц, СВЧ поля и поля пространственного заряда для разных давлений и поглощенных плазмой мощностей. Размер плазмы (см. рис. 3) растет при увеличении поглощенной мощности при неизменном давлении и при уменьшении давления при неизменной мощности, что качественно совпадает с данными экспериментов. При приведенном давлении 0,5 Тор результаты расчетов и экспериментов согласуются в пределах 50–60%, при больших давлениях различие достигает 20–30%. Отметим, что здесь решалась упрощенная модельная задача о возможности формирования плазмы, сосредоточенной вблизи электрода в камерах больших размеров.

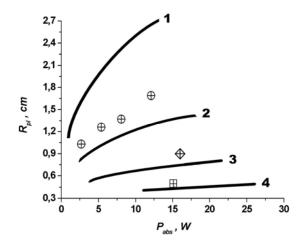


Рис. 3. Радиус плазмы от поглощенной в ней мощности при различных давлениях: сплошные линии — расчет, числа 1, 2, 3, 4 соотв. $p=0.5,\ 1,\ 2,\ 4\ Top,\ T_g=300$ $T_g\approx 600\ K$ (приведенное давление 0.5 Top); ромб — $p=4\ Top,\ T_g\approx 600\ K$; квадрат — $p=8\ Top,\ T_g\approx 600\ K$.

Работа поддержана грантом РФФИ (№ 02-02-16021), Программой фундаментальных исследований Президиума РАН № 20 «Взаимодействие плазмы с высокоскоростными потоками газа» и грантом NWO-РФФИ 047.016.019.

Литература

- 1. Бардош Л., Лебедев Ю.А. // Физика плазмы. 1998. Т. 24. № 10. С. 956.
- 2. Лебедев Ю.А., Мокеев М.В. // ТВТ. 2000. Т. 38. № 3. С. 381.
- 3. Бардош Л., Лебедев Ю.А. // ТВТ. 2000. Т. 38. N 4. С. 552.
- 4. Lebedev Yu.A., Tatarinov A.V., Epstein I.L. // Plasma Sour. Sci&Technol. − 2002. № 11. P. 146.
- 5. *Гильденбург В.Б.*, *Марков Г.А.* // Письма в ЖТФ. 1982. Т. 8. Вып. 20.
- 6. Andrews J.G., Allen J.E. // Proc. Roy. Soc. Lond. A. 1971. V. 320. P. 459.
- 7. *Lapuerta V and Ahedo E.* // Phys. Plasmas. 2000. V. 7. P. 2693.